

IEC 62047-10
(First edition – 2011)

Semiconductor devices –
Micro-electromechanical devices –

Part 10: Micro-pillar compression test for MEMS
materials

CEI 62047-10
(Première édition – 2011)

Dispositifs à semiconducteur –
Dispositifs microélectromécaniques –

Partie 10: Essai de compression utilisant
la technique des micro-piliers pour les
matériaux des MEMS

CORRIGENDUM 1

5.3 Test procedure

Replace, in item e) of this subclause, “If necessary repeat b) and d)” by “If necessary, repeat b) to d)”.

5.3 Procédure d’essai

Remplacer, au point e) de ce paragraphe, “Si nécessaire, répéter b) et d)” par “Si nécessaire, répéter b) jusqu’à d)”.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[IEC 62047-10:2011/COR1:2012](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/116821df-e9bf-45d8-a4ab-4f39daf814d7/iec-62047-10-2011-cor1-2012)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/116821df-e9bf-45d8-a4ab-4f39daf814d7/iec-62047-10-2011-cor1-2012>